

Seminář odd. 26 Tenkých vrstev a nanostruktur

Program semináře o Scanning Microwave Microscopy

Fyzikální ústav AVČR, Cukrovarnická 10, zasedací místnost, budova B

Spolu s Dr. Matthiasem Fennerem z Agilentu přijede i Dr. Joseph Shaw z Imperial College London.

Navrhovaný program je:

Úterý 17. dubna 2012

10:00 Zahájení, Přehled metod měření elektrických vlastností materiálů pomocí AFM, Dr. Matthias Fenner, Agilent Technologies

10:30 Fabricating organic semiconductor nanostructures, Dr. Joseph Shaw, Imperial College London (abstrakt posílám na konci E-mailu)

11:30 Scanning Microwave Microscopy – Principles, Advantages, Calibration, Dr. Matthias Fenner, Agilent Technologies

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd

13:30 Ukázky měření SMM + měření vzorků FZÚ pomocí SMM

Středa 18. dubna 2012

9:00 Měření vzorků FZÚ pomocí SMM dle zájmu účastníků

odborný garant: *RNDr. Antonín Fejfar, CSc.*